

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0400U002853

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 15-11-2000

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Лоп'янка Михайло Антонович

2. Lop'yanka Mykhajlo Antonovych

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 01.04.18

Назва наукової спеціальності: Фізика і хімія поверхні

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 14-10-2000

Спеціальність за освітою: 2105

Місце роботи здобувача: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Код за ЄДРПОУ: 02125266

Місцезнаходження: 76025, Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): К 20.051.03

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Код за ЄДРПОУ: 02125266

Місцезнаходження: 76025, Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 29.19.31

Тема дисертації:

1. Оптимізація технології і моделювання фізичних процесів у тонких плівках AIVBVI та структурах на їх основі.
2. Optimization of technology and simulation of physical processes in thin films AIVBVI and frames on their basis.

Реферат:

1. Об'єкт дослідження: тонкі плівки сполук AIVBVI та тверді розчини на їх основі. Мета дослідження: оптимізація технології вирощування з парової фази тонких плівок AIVBVI та вивчення залежності їх властивостей від технологічних факторів з допомогою методів математичного моделювання та планування експерименту. Методи дослідження: мікрорентгенівський спектральний аналіз, двокристална спектрометрія і топографія, електронна Оже-спектроскопія, радіаційне опромінення альфа-частинками, ізотермічний та ізохронний відпал у вакуумі і на повітрі. Теоретичні і практичні результати і новизна: встановленні залежності електрофізичних параметрів тонких плівок халькогенідів свинцю і олова від технологічних факторів у вигляді поліноміальних рівнянь та гіперповерхонь відгуку. Ступінь впровадження: використовується в навчальному процесі Прикарпатського університету ім. В. Стефаника. Сфера впровадження: мікроелектроніка, підприємства які займаються виготовленням фотоелектричних

пристроїв

2. A thesis is dedicated to study of effect of operational technology factors of growing from a vapour phase on physical properties of thin films of monochalcogenide of lead, tin and solid solutions on their basis: $PbSe_{1-x}Te_x$, $PbXSn_{1-x}Te$, $(SnSe)_{1-x}(PbTe)_x$, $(SnTe)_{1-x}(PbSe)_x$ by a method of a hot-wall. Are offered both the technological diagrams are constructed and the technology is optimized, which one ensure cultivation of a thin-film material with beforehand given parameters. The physicochemical model of process of growing of films AIVBVI from a vapour phase is offered. On the basis of the generative - recombinational mechanism of a radiation defect formation the dosed dependences of concentrations of charge carriers in acting epilayers are explained at an exposure by alpha-particles.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Підсумки дослідження:

Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Фреїк Дмитро Михайлович

2. Фреїк Дмитро Михайлович

Кваліфікація: д.х.н., 05.27.06

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Раренко Іван Михайлович
2. Раренко Іван Михайлович

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.10

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Панченко Олег Антонович
2. Панченко Олег Антонович

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.07

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
голови ради**

Фреїк Дмитро Михайлович

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
головуючого на засіданні**

Фреїк Дмитро Михайлович

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Реєстратор

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**



Юрченко Т.А.